## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-319820

(43) Date of publication of application: 03.12.1996

(51)Int.CI.

F01N 3/02 F01N 3/02 F01N F01N F02D 9/04

(21)Application number: 07-124851

(22)Date of filing:

24.05.1995

(71)Applicant: HINO MOTORS LTD

(72)Inventor: IGARASHI TATSUOKI

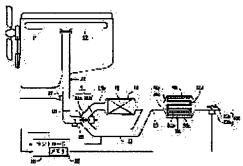
SHIMODA MASATOSHI

#### (54) EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate by oxidation particulate cumulated on a particulate filter in a comparatively simple structure in which an electric heater, a burner, and the like are not used.

CONSTITUTION: A bypass pipe 17 is connected to an exhaust pipe 13 so as to bypass a catalyst converter 14, respective flow rates of the catalyst converter 14 of exhaust gas and a bypass pipe 17 is regulated by a first valve 21, and a first valve 21 is controlled by a controller 28 on the basis of the detecting output of a temperature sensor 26 for detecting the exhaust gas temperature of an exhaust gas upstream side by the catalyst converter 14. A particulate collector 23 is arranged in the exhaust pipe 13 of an exhaust gas downstream side from the catalyst converter 14 and the bypass pipe 17, and a second valve 22 is arranged on the exhaust pipe 13 of an exhaust gas downstream side from the particulate collector 23 so as to regulate an exhaust gas flow rate. The first and second valves 21, 22 are controlled on the basis of detecting output of the temperature sensor 26 by a controller 28.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

10.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3250645

[Date of registration]

16.11.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-319820

(43)公開日 平成8年(1996)12月3日

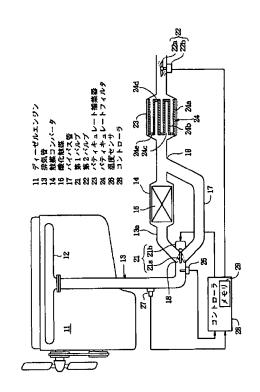
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所	
F 0 1 N	3/02	3 2 1		F 0	1 N	3/02		3 2 1 B		
								3 2 1 D		
		ZAB						ZAB		
	3/20	ZAB				3/20		ZABD		
								ZABP		
			審査請求	未請求	請求	項の数1	OL	(全 5 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	<del>}</del>	特願平7-124851		(71)	出願人	000005	000005463			
						日野自	動車工	業株式会社		
(22)出願日		平成7年(1995)5月	124日			東京都	東京都日野市日野台3丁目1番地1			
					発明者	千五十嵐	龍起			
						東京都	日野市	日野台3丁目	1番地1 日野	
(		(				自動車	工業株	式会社内		
				(72)発明者	千田 十	下田 正敏				
							東京都日野市日野台3丁目1番地1 日野			
							自動車工業株式会社内			
				(74)	代理人	、 弁理士	須田	正義		

### (54)【発明の名称】 排ガス浄化装置

#### (57) 【要約】

【目的】電気ヒータやパーナ等を用いない比較的簡単な 構造で、パティキュレートフィルタに堆積したパティキ ュレートを酸化除去できる。

【構成】触媒コンバータ14を迂回するように排気管13にパイパス管17が接続され、排ガスの触媒コンバータ14及びパイパス管17へのそれぞれの流量を第1パルプ21が調整し、更に触媒コンバータ14より排ガス上流側の排ガス温度を検出する温度センサ26の検出出力に基づいてコントローラ28が第1パルプ21を制御する。本発明の特徴ある構成は、触媒コンパータ14及びパイパス管17より排ガス下流側の排気管13にパティキュレート捕集器23が設けられ、パティキュレート捕集器23が設けられ、パティキュレート捕集器23が設けられ、パティキュレート捕集器23が設けられ、コントローラ28が温度センサ26の検出出力に基づいて第1及び第2パルプ21、22を制御する。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エンジン(11)の排気管(13)に設けられ酸化触媒(16)が収容された触媒コンバータ(14)と、前記触媒コンバータ(14)を迂回するように前記排気管(13)に接続されたバイバス管(17)と、排ガスの前記触媒コンバータ(14)及び前記バイパス管(17)へのそれぞれの流量を調整可能な第1バルブ(21)と、前記触媒コンバータ(14)より排ガス上流側の排ガス温度を検出する温度センサ(26)と、前記温度センサ(26)の検出出力に基づいて前記第1バルブ(21)を制御するコントローラ(28)とを備えた排ガス浄化装置において、

前記触媒コンバータ(14)及び前記バイパス管(17)より排 ガス下流側の前記排気管(13)に設けられパティキュレートフィルタ(24)が収容されたパティキュレート捕集器(2 3)と、

前記パティキュレート捕集器(23)より排ガス下流側の前記排気管(13)に設けられ前記排気管(13)を流れる排ガス流量を調整可能な第2パルブ(22)とを備え、

前記コントローラ(28)が前記温度センサ(26)の検出出力 に基づいて前記第1及び第2パルプ(21,22)を制御する 20 ように構成されたことを特徴とする排ガス浄化装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はエンジン、特にディーゼルエンジンから排出される排ガスを浄化する装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、この種の装置として、エンジンの 排気管に酸化触媒が収容された触媒コンバータが設けら れ、触媒コンパータを迂回するように排気管にバイパス 30 管が接続され、排ガスの触媒コンパータ及びパイパス管 へのそれぞれの流量を第1パルブが調整し、更に触媒コ ンバータより排ガス上流側の排ガス温度を検出する温度 センサの検出出力に基づいてコントローラが第1パルブ を制御するように構成された排気ガス処理装置が開示さ れている(実開平4-75124)。この装置では、温 度センサが酸化触媒による排ガス浄化作用を得られる所 定の活性化温度範囲内の温度、即ち温度Tiより高い排 ガス温度を検出すると、パイパス管への排ガスの流入を 遮断して排ガスを触媒コンパータに導き、このコンパー 40 夕に収容された酸化触媒により排ガスを浄化する。また 温度センサが例えばエンジンの軽負荷運転時のように、 酸化触媒による排ガス浄化作用を得られる所定の活性化 温度範囲から外れた温度、即ち温度Ti以下の排ガス温 度を検出すると、触媒コンパータへの排ガスの流入を遮 断してパイパス管に導くようになっている。

【0003】一方、エンジンの排ガス中のパティキュレ 流量を調整 ートを除去するために、排気管にパティキュレートフィ ラ28が ルタが収容されたパティキュレート捕集器が設けられた 第2パルンパティキュレート除去装置が知られている。この装置で 50 ろにある。

は、フィルタにパティキュレートが堆積してフィルタが 目詰まりすると、電気ヒータやパーナ等により捕集され たパティキュレートを焼却することによりフィルタを再 生するようになっている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の排気ガス処理装置では、排ガス温度が酸化触媒による排ガス浄化作用の低い温度T」以下のときには、排ガスを浄化せずにバイパス管を介してそのまま大気に排出してしまい、排ガスを十分に浄化できない不具合があった。また、上記従来の排気ガス処理装置では、排ガス温度が温度T」を越えて極めて高くなると、排ガス中の硫黄分が酸化されて硫酸塩が生成される問題点もあった。また、上記従来のパティキュレート除去装置では、パティキュレートフィルタの目詰まり時にフィルタを再生するための電気ヒータやバーナを必要とし、かつパティキュレートの捕集量検出部の構造が複雑であり、製造コストを押上げる問題点があった。更に、上記従来のパティキュレート除去装置では、上記捕集量検出部の信頼性が低い問題点があった。

【0005】本発明の目的は、電気ヒータやバーナ等を用いない比較的簡単な構造で、パティキュレートフィルタに堆積したパティキュレートを酸化除去できる排ガス浄化装置を提供することにある。本発明の別の目的は、排ガス温度が極めて高いときには排ガスをバイパス管に導くことにより酸化触媒での硫酸塩の生成を防止でき、排ガス温度が低いエンジンの軽負荷運転時であってもパティキュレートフィルタに堆積したパティキュレートを酸化除去できる排ガス浄化装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明の構成を、実施例に対応する図1を用いて説明 する。本発明は、エンジン11の排気管13に設けられ 酸化触媒16が収容された触媒コンパータ14と、触媒 コンパータ14を迂回するように排気管13に接続され たバイパス管17と、排ガスの触媒コンパータ14及び パイパス管17へのそれぞれの流量を調整可能な第1パ ルプ21と、触媒コンパータ14より排ガス上流側の排 ガス温度を検出する温度センサ26と、温度センサ26 の検出出力に基づいて第1パルプ21を制御するコント ローラ28とを備えた排ガス浄化装置の改良である。そ の特徴ある構成は、触媒コンパータ14及びパイパス管 17より排ガス下流側の排気管13に設けられパティキ ュレートフィルタ24が収容されたパティキュレート捕 集器23と、パティキュレート捕集器23より排ガス下 流側の排気管13に設けられ排気管13を流れる排ガス 流量を調整可能な第2パルプ22とを備え、コントロー ラ28が温度センサ26の検出出力に基づいて第1及び 第2パルプ21,22を制御するように構成されたとこ

3

[0007]

【作用】エンジン11の軽負荷運転時にはコントローラ 28は比較的低い排ガス温度を検出した温度センサ26 の検出出力に基づいて第1パルプ21を制御しバイパス 管17を閉止して排ガスを触媒コンパータ14に導くと 同時に、第2バルブ22を絞って排気抵抗を増すことに より排ガス温度を上昇させる。この結果、エンジン11 の軽負荷運転時であっても、酸化触媒16が活性化する ので、排ガス中の一酸化窒素が酸化触媒により二酸化窒 案に転化され、この二酸化窒素はパティキュレートフィ 10 ルタ24により捕集されたパティキュレートを酸化除去

【0008】またエンジン11の中負荷運転時には排ガ スが所定の温度範囲内にあるので、コントローラ28は 第2パルプ22を全開にする。この結果、酸化触媒16 にて二酸化窒素が生成されるので、この二酸化窒素によ りパティキュレートフィルタ24に堆積したパティキュ レートが酸化除去される。更にエンジン11の高負荷運 転時にはコントローラ28は極めて高い排ガス温度を検 出した温度センサ26の検出出力に基づいて第1パルプ 20 21を制御し、排ガスを触媒コンパータ14を迂回し て、即ちパイパス管17を介してパティキュレート捕集 器23に導入する。これは高温の排ガスを触媒コンパー タ23に導入することにより酸化触媒16にて生成され るミスト状の硫酸塩の生成を防止するためである。

[0009]

【実施例】次に本発明の一実施例を図面に基づいて詳し く説明する。図1に示すように、ディーゼルエンジン1 1の排気マニホルド12には排気管13の一端が接続さ れ、この排気管13の途中には触媒コンパータ14が設 30 けられる。この触媒コンパータ14には酸化触媒16が 収容される。酸化触媒16はこの例ではハニカム状又は ペレット状に形成された多孔質のアルミナのセラミック 担体に白金又はパラジウム等の貴金属を分散して担持さ せることにより形成される。

【0010】また排気管13には触媒コンパータ14を 迂回するようにパイパス管17が接続される。即ちパイ パス管17は排気管13のうちパイパス管17の排ガス 上流端が接続された分岐部18とパイパス管17の排ガ ス下流端が接続された合流部19との間に位置する主管 40 13 a に並列に接続される。排気管13の分岐部18に は排ガスの主管13a及びパイパス管17へのそれぞれ の流量を調整可能な第1バルプ21が設けられる。この バルプ21は主管13a及びバイパス管17を開閉する 第1パルプ本体21aと、この第1パルプ本体21aを 駆動する第1駆動手段21bとを有する。第1パルプ本 体21aは第1駆動手段21bにより主管13a及びバ イパス管17の両者に同時に排ガスを導入可能な実線で 示す中立位置と、主管13aを開放しかつパイパス管1

aを閉止しかつバイパス管17を開放する破線で示すバ

イパス管開放位置との3位置に回動可能に構成される。 [0011] 触媒コンパータ14及びパイパス管17よ り排ガス下流側の排気管13、即ち合流部19より排ガ ス下流側の排気管13にはパティキュレート捕集器23 が設けられ、この捕集器23にはパティキュレートフィ ルタ24が収容される。フィルタ24はこの例では多孔 質の耐熱性セラミック材料により形成されたハニカムフ ィルタであり、円筒状のフィルタ本体24aと、このフ ィルタ本体24a内に排ガス流の方向に延びる格子状の 隔壁24bと、この隔壁24bにより形成された断面略 長方形状の複数の排ガス通路24cと、これらの通路2 4 c の出口を1つ置きに目封じする出口側栓24 dと、 出口側栓24dにより目封じされていない排ガス通路2 4 c の入口を目封じする入口側栓24eとを有する。排 ガス中のパティキュレートは上記隔壁24bを通過する 際に捕集されるようになっている。パティキュレート捕 集器23より排ガス下流側の排気管13にはこの排気管 13を流れる排ガス流量を調整可能な第2パルプ22が 設けられる。このバルブ22は第2バルブ本体22a と、この第2バルブ本体22aを駆動する第2駆動手段 2 2 b とを有する。第 2 パルプ本体 2 2 a は排気管 1 3 を全開する実線で示す全開位置及び排気管13を半開に する破線で示す半開位置の2位置に回動可能に構成され

【0012】分岐部18より排ガス上流側の排気管13 には、触媒コンパータ14より排ガス上流側の排ガス温 度を検出する温度センサ26と、分岐部より排ガス上流 側の排ガス圧力を検出する圧力センサ27とが設けられ る。温度センサ26及び圧力センサ27の各検出出力は コントローラ28の制御入力に接続され、コントローラ 28の制御出力は第1及び第2駆動手段21b、22b に接続される。コントローラ28にはメモリ29が設け られ、このメモリ29には第1及び第2パルプ21,2 2を切換える条件である所定の温度及び所定の圧力が記 憶される。所定の温度はこの例では550℃及び300 ℃であり、所定の圧力はこの例では200mmHgであ る。また図2に示すように排ガス温度Tが300℃以下 では一酸化窒素の二酸化窒素への転化率は低く、排ガス 温度Tが300℃~550℃では上記転化率は急激に上 昇し、排ガス温度下が550℃以上になると上記転化率 は略一定になることが知られている。

【0013】このように構成された排ガス浄化装置の動 作を図1~図3に基づいて説明する。エンジン11始動 直後や軽負荷運転時には排ガス温度は比較的低く、温度 センサ26は排ガス温度T=550℃未満を検出する。 コントローラ28は上記温度センサ26の検出出力に基 づいて第1駆動手段21bを駆動し、第1パルプ本体2 1 aを図1の一点鎖線で示す主管開放位置に回転させ 7を閉止する一点鎖線で示す主管開放位置と、主管13 50 る。またエンジン11始動直後や軽負荷運転時であって

もパティキュレートフィルタ24に所定量以上のパティ キュレートが堆積し、圧力センサ27が排ガス圧力P= 200mmHg以上を検出すると、コントローラ28は 上記圧力センサ27の検出出力に基づいて第2駆動手段 22 bを駆動し、第2バルプ本体22 aを破線で示す半 開位置にし、排気抵抗を増すことにより排ガス温度を上 昇させる。温度センサ26が排ガス温度T=300℃を 越えたことを検出すると、コントローラ28は第2駆動 手段22bを介して第2パルプ本体22aを実線で示す 全開位置にする。排ガス温度が300℃を越えると、図 10 2に示すように酸化触媒16が活性化し、一酸化炭素や 炭化水素等の有害ガスを二酸化炭素や水等の無害な物質 に転化するとともに、一酸化窒素を二酸化窒素に転化す る。転化された二酸化窒素はパティキュレート捕集器2 3に導入され、パティキュレートフィルタ24により捕 集されたパティキュレートを酸化除去する。この結果、 エンジン11始動直後や軽負荷運転時であっても、フィ ルタ24に堆積したパティキュレートを除去できる。

【0014】またエンジン11が中負荷運転されると、 排ガス温度は300℃~550℃の範囲内になるので、 上記と同様に酸化触媒16にて生成された二酸化窒素に よりパティキュレートフィルタ24に堆積したパティキ ュレートが酸化除去され、フィルタ24はパティキュレ ートの堆積による目詰まりを生じない。エンジン11が 高負荷運転されて温度センサ26が排ガス温度T=55 0℃以上を検出すると、コントローラ28は第1駆動手 段21bを駆動して第1パルプ本体21aを図1の破線 で示すパイパス管開放位置に回転させ、排ガスを触媒コ ンパータ14を迂回してパティキュレート捕集器23に 導入する。これは高温の排ガスを触媒コンパータ16に 30 ートを酸化除去できる。 導入すると、排ガス流の硫黄分が酸化触媒16にて酸化 されてミスト状の硫酸塩が生成されるのを回避するため である。高負荷運転時にフィルタ24に堆積したパティ キュレートは排ガスの熱のみで酸化除去される。

【0015】なお、上記実施例では第1バルブを中立位 置、主管開放位置及びバイパス管開放位置の3段階に制 御し、第2パルプを全開位置及び半開位置の2段階に制 御したが、第1パルプを主管開放位置及びパイパス管開 放位置の2段階又は4段階以上に制御し、第2パルプを 3段階以上に制御してもよい。この場合、より細かな最 40 適化が可能となる。また、上記実施例ではコントローラ の制御入力に温度センサ及び圧力センサの各検出出力を 接続したが、パティキュレートフィルタに堆積したパテ ィキュレートを完全に二酸化窒素により酸化除去できれ ば、圧力センサを用いずに温度センサののみをコントロ ーラの制御入力に接続してもよい。この場合、コントロ ーラは温度センサの検出出力に基づいて第1及び第2パ ルプを制御する。更に、上記実施例で挙げた排ガス温度

及び排ガス圧力の数値は一例であってこれらの数値に限 定されるものではない。

#### [0016]

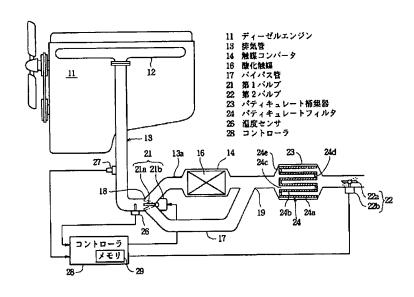
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、触 媒コンバータ及びこのコンパータを迂回するバイパス管 より排ガス下流側の排気管にパティキュレート捕集器を 設け、コントローラが排ガス温度を検出する温度センサ の検出出力に基づいて、排ガスの触媒コンパータ及びパ イパス管へのそれぞれの流入量を調整する第1パルブ と、パティキュレート捕集器より排ガス下流側の排気管 への排ガス流量を調整する第2パルプとを制御するよう に構成したので、排ガス温度が酸化触媒による排ガス浄 化作用の低い温度以下のときに、排ガスを浄化せずにバ イパス管を介してそのまま大気に排出してしまう従来の 排気ガス処理装置と比較して、本発明では排ガス温度が 低いエンジンの軽負荷運転時であってもパティキュレー トフィルタに堆積したパティキュレートを酸化除去でき る。

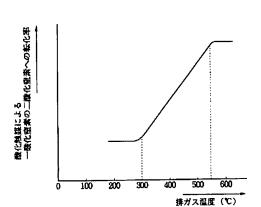
【0017】また、排ガス温度が極めて高くなると、排 20 ガス中の硫黄分を酸化して硫酸塩を生成する従来の排ガ ス処理装置と比較して、本発明では排ガス温度が極めて 髙くなると、排ガスをバイパス管に導くことにより酸化 触媒での硫酸塩の生成を防止できる。更に、パティキュ レートフィルタの目詰まり時にフィルタを再生するため の電気ヒータやパーナを必要とし、かつパティキュレー トの捕集量検出部の構造が複雑であり、製造コストを押 上げる従来のパティキュレート除去装置と比較して、本 発明では電気ヒータやパーナ等を用いない簡単な構造 で、パティキュレートフィルタに堆積したパティキュレ

#### 【図面の簡単な説明】

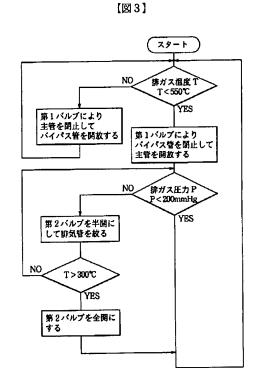
- 【図1】本発明一実施例の排ガス浄化装置の構成図。
- 【図2】排ガス温度の変化に対するNOのNO2への転 化率を示す図。
- 【図3】その装置の動作を示すフローチャート。 【符号の説明】
- 11 ディーゼルエンジン
- 13 排気管
- 14 触媒コンパータ
- 16 酸化触媒
  - 17 パイパス管
  - 21 第1パルプ
  - 22 第2パルブ
  - 23 パティキュレート捕集器
  - 24 パティキュレートフィルタ
  - 26 温度センサ
  - 28 コントローラ

## 【図1】





【図2】



## フロントページの続き

• , ,

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
F 0 1 N	3/24	ZAB		F 0 1 N	3/24	ZABE	
F 0 2 D	9/04			F 0 2 D	9/04	E	